

# 近赤外2000nm対応対物レンズ

## PEIR2000HR 20X・50X

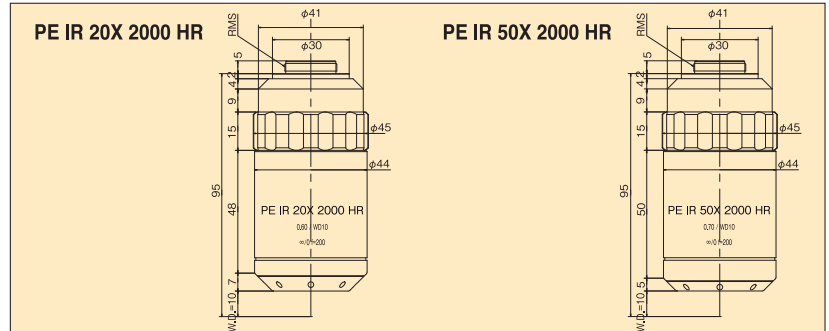
2000nmで80%以上の透過率を維持した対物レンズです。半導体デバイスの故障解析で電流リークによる極微弱な発光の検出に威力を発揮いたします。高集積、多層配線化された半導体デバイスを、チップの裏面からシリコンを透過してくる赤外光で観察が可能です。  
※シリコン補正対応いたします。ご相談ください。



### 仕様

型式	PE IR 20X 2000 HR	PE IR 50X 2000 HR
倍率	20X	50X
作動距離	10mm	10mm
焦点距離(f)	10mm	4mm
N.A.	0.6	0.7
分解能	1.6 $\mu$ m	1.4 $\mu$ m
焦点深度(±D.F)	2.1 $\mu$ m	1.5 $\mu$ m
透過率	1300nm 2000nm	80%以上 80%以上
重量	610g	560g

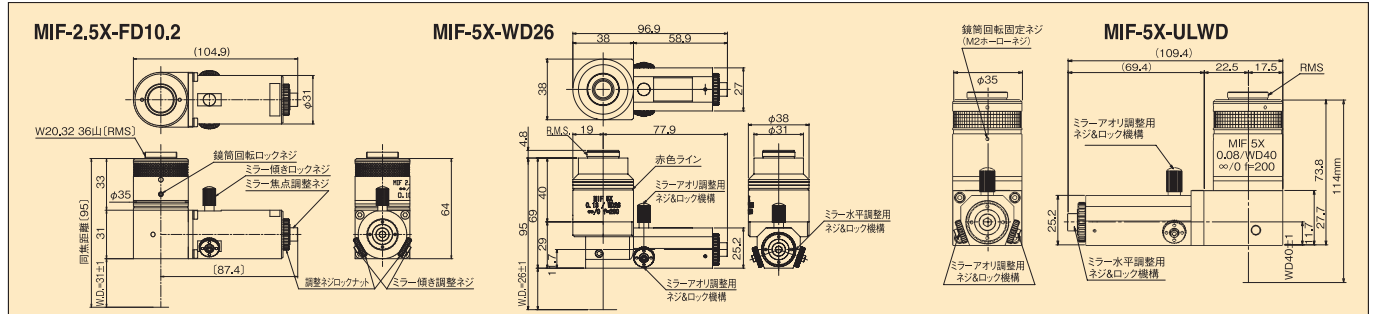
※PE IR 2000シリーズの分解能及び焦点深度は、基本波長( $\lambda=1550$ nm)をもとに算出した値です。  
※分解能 $=0.61\lambda/N.A.$  焦点深度 $\pm D=\lambda/(2(N.A.)^2)$



# マイケルソン式白色干渉対物レンズ

## MIFシリーズ

白色干渉計での使用を目的とした対物レンズです。合焦位置でのサンプル像とともに内蔵するビームスプリッタと参照ミラーによりサンプルの高低差に対応した干渉縞が得られます。



### 仕様

※カスタマイズで製作する受注製品で、上図は製作例です。シャッターの有無、参照ミラーの調整方法などをご相談の上製作いたします。又、対象物に合わせた反射率の参照ミラーもご用意可能です。

型式	MIF-2.5X-FD10.2	MIF-5X-WD26	MIF-5X-ULWD
倍率	2.5X	5X	5X
作動距離	31mm	26mm	40mm
焦点距離(f)	80mm	40mm	40mm
N.A.	0.1	0.13	0.08
分解能	3.4 $\mu$ m	2.6 $\mu$ m	4.2 $\mu$ m
焦点深度(±D.F)	27.5 $\mu$ m	16.3 $\mu$ m	42.9 $\mu$ m
波長	486-656nm	486-656nm	486-656nm
参照ミラー面精度	$\lambda/20$	$\lambda/20$	$\lambda/20$
同焦点距離	95mm	95mm	114mm

※分解能 $=0.61\lambda/N.A.$  焦点深度 $\pm D=\lambda/(2(N.A.)^2)$

# リ尼克式干渉対物レンズ

## LIFシリーズ

カスタム設計製造しています。お問い合わせください。

